

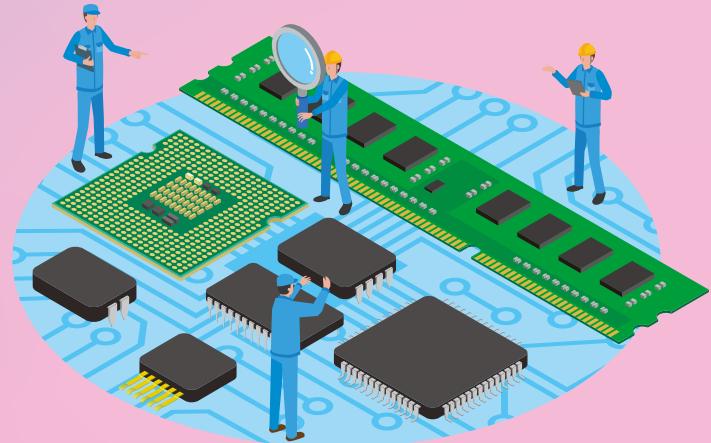
# Lab to Fab 2

## 量産化とグリーン化を突破するための半導体研究

2026/03/16(月) 13:30-18:00

東京科学大学 大岡山キャンパス/Zoomハイブリッド

半導体研究が社会に実装されるためには、量産化の可能性やグリーン化といった現場起点の制約を踏まえた研究設計が不可欠です。本シンポジウムでは、半導体工場の現場が直面する技術的・工程的な制約や要請を研究者と共有し、それを起点に新たな発想や設計思想を築くことを目指します。研究と現場の対話を通じて、我が国の半導体産業が再び輝く未来に向けて、量産化とグリーン化を突破する研究のあり方をともに考えます。



### 招待講演

**上野 隆康** デジタル化がもたらす半導体工場の未来：AI とスマートファクトリー  
キオクシア株式会社

**鶴崎 宏亀** 高品質チップを最速で市場へ：Rapidus の DMCO/Raads 戦略が変える半導体開発の未来  
Rapidus 株式会社

**高石 将輝** プロセスインフォマティクスによる半導体製造技術の深化  
アイクリスタル株式会社

**高橋 堅太** 半導体製造グリーン化への化学産業の貢献：廃酸類リサイクル事業  
下関三井化学株式会社

**宮島 弘樹** グリーンな半導体製造に向けたウェットプロセス革新とエコシステムづくり  
株式会社 SCREEN セミコンダクターソリューションズ

### 一般講演

**岡地 涼輔** 他 物理に基づく中間変数を用いた ALD-SiO<sub>2</sub> 複数回アニールモデルの再利用性検証  
株式会社豊田中央研究所

**平田 佑亮** 他 少数データセットにおけるガウス過程回帰を用いた単一濃度・温度条件に対する Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 膜のウェットエッチャリング量予測  
ガウス過程回帰を用いた複数の薬液条件における SiO<sub>2</sub> 膜 /Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> 膜のウェットエッチャリング量予測  
東京大学, 株式会社 SCREEN セミコンダクターソリューションズ

**石田 茉大** 他 サステナブルな ALD の原料オンデマンド供給を可能にする高速開閉バルブの動作制御  
熊本大学, 株式会社堀場エステック

司会人：青野 真士 (Amoeba Energy株式会社), 中川 真一 (株式会社SCREENセミコンダクターソリューションズ),  
秋永 広幸 (北海道大学), 三津江 敏之 (デロイトトーマツ コンサルティング合同会社)

企画：半導体グリーンファブ研究会